文章编号:1001-9014(2024)06-0738-06

# 12.5 μm 1024×1024 长波 InAs/GaSb II 类超晶格 红外焦平面探测器

白治中\*, 黄 敏, 徐志成, 周 易, 朱艺红, 沈益铭, 张君玲, 陈洪雷, 丁瑞军, 陈建新 (中国科学院上海技术物理研究所 红外探测全国重点实验室,上海 200083)

**摘要:**报道了12.5 µm的InAs/GaSb II 类超晶格长波红外焦平面探测器。实验采用分子束外延技术在GaSb衬底上 生长超晶格材料。吸收区超晶格结构为15ML(InAs)/7ML(GaSb)。探测器采用PB $\pi$ BN的双势垒结构以抑制长波 探测器暗电流。研制了规模为1024×1024、像元中心距为18 µm的长波焦平面探测器。采用金属杜瓦封装,与 制冷机耦合形成超晶格长波探测器制冷组件。在60 K 温度下测试了探测器各项性能。探测器50% 截止波长为 12.5 µm,平均峰值探测率达到6.6×10<sup>10</sup> cmHz<sup>12</sup>/W, 盲元率为1.05%, 噪声等效温差 NETD 为21.2 mK。红外焦平面 成像测试得到了清晰的长波图像。

**关 键 词:**焦平面; InAs/GaSb; 超晶格; 长波 **中图分类号**:TN304.2; TN305

文献标识码:A

# 12.5 μm 1024×1024 long-wavelength infrared InAs/GaSb Type II superlattice focal plane arrays

BAI Zhi-Zhong<sup>\*</sup>, HUANG Ming, XU Zhi-Cheng, ZHOU Yi, ZHU Yi-Hong,

SHEN Yi-Ming, ZHANG Jun-Lin, CHEN Hong-Lei, DING Rui-Jun, CHEN Jian-Xin

(National Key Laboratory of Infrared Detection Technologies, Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200083, China)

Abstract: In this paper, the research results of 12. 5  $\mu$ m long-wavelength infrared InAs/GaSb superlattice focal plane arrays were reported. The superlattice structure was grown on GaSb substrate using molecular beam epitaxy (MBE) technology. The respective structure of absorption region is 15ML (InAs) /7ML (GaSb). The detector adopts PB $\pi$ BN double barrier structure to suppress the dark current. A long-wave focal plane detector with the size of 1 024×1 024 and the pixel center-to-center distance of 18  $\mu$ m was developed. The detector was packaged by a metal dewar, and a superlattice long-wavelength detector cryocooler assembly was formed by coupling with a refrigerator. Measured at 60 K, the detector has 50% cut-off wavelength of 12. 5  $\mu$ m. The detector has a peak detectivity of 6. 6×10<sup>10</sup> cm•Hz<sup>1/2</sup>/W , dead pixels rate of 1. 05% and a noise equivalent temperature difference (NETD) of 21. 2 mK. The infrared images have been taken clearly using this infrared imaging detector.

Key words: focal plane array, InAs/GaSb, superlattice, long wavelength

# 引言

InAs/GaSb II类超晶格红外探测技术建立在较

收稿日期:2023-09-19,修回日期:2023-09-30

Received date: 2023-09-19, Revised date: 2023-09-30

为成熟的III-V化合物半导体技术之上,具有能带

灵活可调的特点,其探测波长可覆盖3~30 µm中波

<sup>\*</sup>通讯作者(Corresponding author): E-mail: baizz@mail. sitp. ac. cn

**基金项目:**国家自然基金资助项目(62004205,62104236,62104237,62222412)、国家重点研发计划项目(2022YFB3606800)、上海市启明星培 育项目扬帆专项(21YF1455000、22YF1455800)、中国科学院上海技术物理研究所创新专项基金资助项目(CX-455)

Foundation items: Supported by National Natural Science Foundation of China (NSFC) (62004205, 62104236, 62104237, 62222412), National Key Research and Development Program of China (2022YFB3606800), Shanghai Rising-Star Program (21YF1455000, 22YF1455800) and Special Fund for Innovation of SITP, CAS (CX-455)

作者简介(Biography):白治中(1984-),男,湖南益阳人,博士,副研究员,主要从事 InAs/GaSb II 类超晶格红外焦平面探测器研究。 E-mail: baizz@mail.sitp.ac.cn

至远红外波段。除了可以调节能带宽带,InAs/GaSb 超晶格结构还可以应用能带工程来改变能带结构。 通过能带结构设计,使得重空穴带和轻空穴带有较 大的分离,从而抑制Auger复合。超晶格材料的有 效质量不直接依赖于其禁带宽度。相比HgCdTe材 料, InAs/GaSb超晶格有更大的有效质量, 特别在长 波波段,高的有效质量将十分有助于抑制遂穿暗电 流<sup>[1-2]</sup>。InAs/GaSb II类超晶格红外探测技术通过改 变超晶格周期厚度来调节探测截止波长。现代的 材料生长技术,如分子束外延,可以在单原子层的 精度上控制材料生长,保证材料周期厚度的精确控 制,因此超晶格材料具有均匀性高的技术优势。当 探测器的探测率达到1×1010 cm•Hz12/w以上时,决定 焦平面探测器性能的主要因素是其均匀性,而不是 探测率。均匀性对于提高红外系统的温度分辨率 以及提高将探测目标从背景中区分出来的能力是 十分重要的。因此,针对长波和甚长波波段,Ⅱ类超 晶格以其优越的暗电流特性和材料器件均匀性,有 望提高焦平面探测器的温度分辨率,具有鲜明的特 色和潜在优势,成为目前最为热门的红外探测器 技术。

由于其优异的红外探测性能, InAs/GaSb II类 超晶格受到了广泛的关注, 近年来在国际上发展极 为迅速<sup>[3-8]</sup>。美国加州大学在 1996 年首次报道了 InAs/GaSb 超晶格单元探测器。在 78 K 温度下, 响 应波长达到 10.6 μm, 在 8.8 μm 波长时, 探测率达 到 1×10<sup>10</sup> cm•Hz<sup>1/2</sup>/W<sup>[9]</sup>。2003 年美国西北大学报道 了第一个 II 类超晶格焦平面探测器<sup>[10]</sup>。此外, 德国 的 Fraunhofer 研究所、美国的雷神公司、JPL实验室、 以色列 SCD 公司和新墨西哥大学在 InAs/GaSb II 类 超晶格红外焦平面研究方面也取得了一系列 进展<sup>[11-18]</sup>。

本文报道了截止波长为12.5 μm的InAs/GaSb II 类超晶格长波红外焦平面探测器组件。该探测器 采用PBπBN的双势垒外延超晶格结构抑制长波暗 电流,吸收区超晶格结构为15ML(InAs)/7ML (GaSb)。研制了规模为1024×1024,像元中心距为 18 μm的长波焦平面探测器。采用金属杜瓦封装, 与斯特林制冷机耦合形成超晶格长波探测器制冷 组件。在60 K 温度下,探测器平均峰值探测率达到 6.6×10<sup>10</sup> cm•Hz<sup>1/2</sup>W<sup>-1</sup>, 盲元率为1.05%, NETD 为 21.2 mK。

# 1 实验

# 1.1 器件结构设计

针对 12.5 μm 长波探测器,利用锑化物超晶格 能带结构灵活可调的特性,设计并构建了具有暗电 流抑制功能的 pBπBn 双势垒结构超晶格探测器。 势垒结构的引入是抑制长波探测器的暗电流的有 效方法。特别是利用超晶格材料体系能带可调的 优势,人工设计器件结构中的电子势垒和空穴势 垒,既能够抑制台面器件的纵向漏电,又能够将耗 尽区主要形成在势垒区,减少长波器件的隧穿 电流。

针对12.5 μm 长波超晶格焦平面组件的器件结构进行了设计和优化,主要采用双势垒的异质结器件结构,如图1(a)所示,该结构包含P型和N型的重掺电极区、厚膜吸收区以及电子势垒区和空穴势垒区,可表示为PBπBN结构。

对于吸收区,主要考虑了探测器量子效率的设 计。长波超晶格在未进行补偿掺杂时体现为弱 n 型,少子为空穴,由于在超晶格材料中,空穴有效质 量远大于电子,其扩散长度远小于电子,因此将无 法通过增加器件吸收区的厚度来提高器件的量子 效率。通过前期的研究,将吸收区进行 P型的补偿 掺杂,将吸收区的少子由空穴改变为电子,可以有 效提高吸收区的少子扩散长度,从而使得增加吸收 区材料厚度来提高探测器量子效率的方法可行。 针对探测器量子效率的需求,吸收区采用了补偿掺 杂技术及厚膜材料生长技术来提高超晶格吸收区 材料的扩散长度及量子效率。

对于势垒区,针对12.5μm截止波长的长波红 外探测器禁带宽度窄、暗电流高的特点,设计了包 含电子势垒和空穴势垒的势垒增强型探测器结构, 提高器件信噪比,满足焦平面的研制要求。图1(b) 为PBπBN的能带结构图和电场分布图。双势垒的 结构可以有效降低耗尽区的内建电场,从而减小探 测器的暗电流,提高器件性能。同时本文的设计中 采用了缓变异质结来消除尖峰势垒。优化的长波 超晶格探测器结构通过优化设计的缓变结的引入, 可以在抑制暗电流的同时保证光电流的输运不受 尖峰势垒的阻挡,从而保证了探测器的量子效率。

InAs/GaSb II类超晶格材料的生长采用固态源 分子束外延技术。实验采用(100)GaSb 衬底,衬 底表面的脱氧过程和外延过程由在线反射式高能 电子衍射(RHEED)监控。探测器采用pBπBn双势



图1 长波超晶格探测器器件结构及其对应的能带结构图:(a)器件结构;(b)对应的能带结构图

Fig. 1 Structure and the band structure diagram of the long-wavelength superlattice detectors: (a) structure; (b) band structure diagram

垒外延结构,超晶格的吸收区结构为15 ML InAs/ 7ML GaSb。本文研制的焦平面器件规模为1024× 1024,采用台面结构,像元中心距为18 μm。像元 与公共电极台面形成采用电感耦合等离子体(ICP) 干法刻蚀技术获得,化学气相沉积技术(CVD)生长 300 nm厚的SiN<sub>x</sub>薄膜作为钝化层,ICP刻蚀形成电 极孔,电子束蒸发TiPtAu 合金制备欧姆接触电极, 在电极表面生长铟柱。器件经背面机械减薄、切 割、与读出电路(ROIC)倒焊互连后形成长波焦平面 探测器件。最后将器件封装于杜瓦中,与制冷机耦 合形成超晶格长波制冷组件。在60 K 温度下对器 件进行光学和电学性能测试。





采用高分辨X射线衍射仪测试分析InAs/GaSb 超晶格长波探测器结构的晶格质量和周期厚度。 图2是沿3英寸超晶格外延材料径向取点测试的 (004)晶面 X 射线  $\omega/2\theta$  摇摆曲线图。每一个点的 X 射线衍射 $\omega/2\theta$ 摇摆曲线高度重合,显示了超晶格外 延材料的高均匀性。图中位于正中间的主峰及其 肩部分别为GaSb 衬底衍射峰和超晶格外延层零级 衍射峰。从图中可以看出有三组一级衍射峰,其中 位于31.2°处峰强较强、目相互间隔较近的衍射峰 为长波吸收区超晶格结构 15 ML InAs /7ML GaSb 的 正一级衍射峰,而位于31.6°处峰强次强、目相互间隔 较远的一组衍射峰为电子势垒超晶格结构7 ML InAs/ 7ML GaSb的正一级衍射峰。而位于31.8°处峰强最 弱、且相互间隔最远的一组衍射峰为空穴势垒超晶 格结构 8 ML InAs /3.5ML GaSb 的正一级衍射峰。 随着周期厚度增大,各级衍射峰之间间距也随之减 小。从图中可以看出,各级衍射峰尖锐且半高宽较 窄,其中吸收区正一级峰半高宽为14.33 arcsec,电 子势垒区正一级峰半高宽为38.26 arcsec, 空穴势垒 区正一级峰半高宽为55.03 arcsec。显示了材料的 良好的晶格质量。根据卫星峰位置公式,可以分 别计算出超晶格材料零级峰的位置和周期厚度, 分别为6.43 nm(吸收区)、4.35 nm(电子势垒)和 3.66 nm(空穴势垒)。超晶格探测器的周期结构与 设计相吻合。

图 3 为长波超晶格材料的 AFM 测试图像,扫描 范围为 5 μm×5 μm,从图中可以看到,规则排列的 层状结构清晰可见。结果显示,长波超晶格材料表 面粗糙度 *R*a 均小于 0.2 nm。



图 3 长波超晶格材料 AFM 测试图像 Fig. 3 Long-wavelength superlattice materials AFM test image

# 2 结果及分析

# 2.1 暗电流特性

图 4 为 60 K 温度下超晶格长波探测器像元的 *I-V*曲线图。从图中可以看出,得益于本文采用的 双势垒探测器暗电流抑制结构,长波探测器的暗电 流得到了显著的抑制。在偏置电压为-0.05 V 时探 测器像元暗电流为0.6 nA。满足了高性能12.5 μm 长波焦平面探测器对像元暗电流特性的要求。如 何进一步降低长波探测器暗电流是获得高性能长 波超晶格焦平面探测器的关键,后续工作将主要围 绕探测器结构优化和表面钝化开展。



图4 长波超晶格探测器的像元I-V曲线图

Fig. 4 The dark current of long-wavelength superlattice detectors

### 2.2 光谱响应

通过傅里叶红外光谱仪测试探测器的光谱响 应特性。图5为该长波探测器的响应光谱,从图中 可以看出该探测器响应截止波长为12.5μm,该探 测器成功实现了探测器组件的长波段红外探测功 能。本探测器衬底已经完全去除,光谱曲线中的震 荡是由探测器超晶格的F-P腔震荡现象造成的。



图 5 长波超晶格探测器光谱响应曲线 Fig. 5 The responsivity spectrum of long-wavelength superlattice detectors

#### 2.3 焦平面结果

本文研制的长波探测器组件工作温度为60 K, 组件稳定功耗为53 W<sub>acc</sub>。在黑体温度为20 °C~ 35 °C,F数为2的条件下测试了探测器各项性能指标。本文长波焦平面探测器测试结果如表1所示。 其平均峰值探测率为6.6×10<sup>10</sup> cm·Hz<sup>1/2</sup>/W,盲元率 为1.05%,响应非均匀性达到6.2%。图6为该长波 探测器噪声等效温差柱状分布图。图中柱状分布 呈现正态分布的特征。该长波探测器噪声等效温 差均值为21.2 mK,正态分布中心值为21 mK。

长波超晶格焦平面探测器的成像演示图如图7 所示。从图中可清晰地分辨出人的五官、眼镜等图 像特征,成像效果清晰。图中人物手持的为一杯冷 水,可以看出,冷水杯与人脸温度之间的差异明显。 此外,从成像图中还可以看出成像人物脸上皮肤不 同温度的细微差别,显示了该探测器良好的温度分 辨能力。该成像图中盲元未进行校正,为长波探测 器原始成像。从器件的成像演示图和焦平面测试 参数情况可知,该长波红外焦平面探测器具备了开 展实际应用的前景。

741



图 6 超晶格长波探测器噪声等效温差柱状分布图 Fig. 6 NETD column distribution of the superlattice longwavelength detector



Table 1 Test results of superlattice long wave focalplane component at 60K temperature

参数	性能
规模	1 024×1 024
平均响应率 / (V/W)	7. 9×10 <sup>7</sup>
平均峰值探测率 / (cm·Hz <sup>1/2</sup> /W)	6. 6×10 <sup>10</sup>
响应非均匀性 / %	6.2
NETD / mK	21.2
盲元率 / %	1.05
组件功耗/W <sub>a.c</sub>	53





Fig. 7 High definition image of the megapixel long-wavelength detector

# 3 结论

报道了12.5μm的InAs/GaSb II类超晶格长波

红外焦平面探测器组件的研究结果。设计了长波 暗电流抑制的PBπBN的双势全超晶格探测器结构。 采用分子束外延技术在GaSb衬底上生长了高质量 的超晶格材料。研制了规模为1024×1024,像元中 心距为18 μm的长波焦平面探测器。60 K下像元在 -0.05 V偏压处暗电流达到了0.6 nA。采用金属杜 瓦封装,与制冷机耦合形成超晶格长波探测器制冷 组件。在60 K温度下测试了探测器各项性能,该探 测器平均峰值探测率达到6.6×10<sup>10</sup> cm•Hz<sup>1/2</sup>/W,盲 元率为1.05%,NETD为21.2 mK。红外焦平面成像 测试得到清晰的长波成像。

**致谢**:本工作得到了钟艳红、陈昱、杨勇斌、朱建妹、 何高胤、曹晓莹等同志的支持,作者在此表示衷心 的感谢。

#### References

- [1] Smith D L, Maihiot C. Proposal for strained type II superlattice infrared detectors [J]. J. Appl. Phys., 1987, 62: 2545– 2548.
- [2] Hu W D, Chen X S, Ye Z H, et al. A hybrid surface passivation on HgCdTe long wave infrared detector with in-situ CdTe deposition and high-density Hydrogen plasma modification [J]. Appl. Phys. Lett., 2011, 99(9): 091101.
- [3] Sai-Halasz G A, Tsu R, Esaki L. A new semiconductor superlattice [J]. Appl. Phys. Lett., 1977, 30(12): 651 - 653.
- [4] Golding T D, Shih H D, Zborowski J T, et al. Investigation of molecular-beam epitaxially grown InAs/(In, Ga) Sb strained-layer superlattices [J]. Journal of Vacuum Science & Technology B, 1992, 10(2): 880-884.
- [5] Zborowski J T, Fan W C, Golding T D, et al. Epitaxial and interface properties of InAs/InGaSb multilayered structures
   [J]. Journal of applied physics, 1992, 71 (12): 5908– 5912.
- [6] Feenstra R M, Collins D A, Ting D Z Y, et al. Interface roughness and asymmetry in InAs/GaSb superlattices studied by scanning tunneling microscopy [J]. Physical review letters, 1994, 72(17): 2749–2752.
- [7] Walther M, Schmitz J, Rehm R, et al. Growth of InAs/ GaSb short-period superlattices for high-resolution midwavelength infrared focal plane array detectors [J]. Journal of Crystal growth, 2005, 278(1): 156-161.
- [8] Haugan H J, Grazulis L, Brown G J, et al. Exploring optimum growth for high quality InAs/GaSb type-II superlattices [J]. Journal of crystal growth, 2004, 261(4): 471-478.
- [9] Johnson J L, Samoska L A, Gossard A C, et al. Electrical and optical properties of infrared photodiodes using the InAs/Ga1-xInxSb superlattice in heterojunctions with GaSb [J]. J. Appl. Phys., 1996, 80(2):1116-1127.
- [10] Razeghi M, Wei Y, Bae J, et al. Type II InAs/GaSb superlattices for high-performance photodiodes and FPAs
  [J]. Proceedings of SPIE the Internation Society for Optical Engineering, 2003, 5246: 501-511.
- [11] Walther M, Rehm R, Fuchs F, et al. 256×256 focal

plane array mid-wavelength infrared camera based on InAs/GaSb short-period superlattices [J]. *Journal of electronic materials*, 2005, **34**: 722–725.

- [12] Walther M, Rehm R, Fleissner J, et al. InAs/GaSb Type II short-period superlattices for advanced single and dualcolor focal plane arrays [J]. Proc. of SPIE, 2007, 6542: 83–90.
- [13] Rhiger D R, Kvaas R E, Harris S F, et al. Progress with Type II superlattices IR detector arrays [J]. Infrared Technology and Applications . 2007, 6542: 54202-54202.
- [14] Nguyen B M, Hoffman D, Delaunay P Y, et al. Band edge tenability of M-structure for heterojunction design in Sb based type II superlattice photodiodes [J]. Appl. Phys. Lett., 2008, 93(16): 163502.
- [15] Ting D Z, Hill C J, Soibel A, et al. A high-performance

long wavelength superlattice complementary barrier infrared detectors [J]. *Appl. Phys. Lett.*, 2009, **95** (2) : 183502.

- [16] Gautam N, Plis E, Kim H S, et al., "Heterostructure band engineering of type II InAs/GaSb superlattice based long wave infrared photodiodes using unipolar current blocking barriers [J]. Proc. of SPIE, 2010, 7660: 572-577.
- [17] Gunapala S D, Ting D Z, Hill C J, et al. Demonstration of 1k×1k long-wave and mid-wave superlattice infrared focal plane arrays [J]. Proc. of SPIE, 2010, 7808: 780802.
- [18] Klipstein P C, Avnon E, Benny Y, et al. Type-II superlattice detector for long-wave infrared imaging [C]. Proc. of SPIE, 2015, 9451: 94510K.